

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@aist.go.jp を付けてください)

2012年 2月分 (31件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2012-021787	2012/2/3	物品面上の突起の高さを計測する方法及びそのための装置	蒲原 敏浩
2	特願2012-023723	2012/2/7	放射性セシウムを含有する焼却灰の安全な処分方法	川本 徹
3	特願2012-024715	2012/2/8	炭化ケイ素多孔質構造体及びその製造方法	谷 英治
4	特願2012-025141	2012/2/8	液晶配向構造体の製造方法	大園 拓哉
5	特願2012-026025	2012/2/9	鉄含有複合リン酸フッ化物、その製造方法、及びそれを正極活物質として用いた二次電池	鹿野 昌弘
6	特願2012-027268	2012/2/10	携帯型放射線線量計	鈴木 良一
7	特願2012-027314	2012/2/10	携帯型放射線線量計及びこれを使用した放射線量管理システム	鈴木 良一
8	特願2012-026842	2012/2/10	蛍光性増白剤を用いたカーボンナノチューブ分散液	松澤 洋子
9	特願2012-028936	2012/2/13	リグノセルロース系バイオマスからの樹脂原料の製造方法及びその装置	鈴木 明
10	特願2012-027953	2012/2/13	球面モータの制御方法	笠島 永吉
11	特願2012-028274	2012/2/13	耐熱耐圧耐食性マイクロ電極	陶 究
12	特願2012-028275	2012/2/13	耐熱耐圧耐食性電気化学マイクロセル	陶 究
13	特願2012-028276	2012/2/13	耐熱耐圧耐食性温度測定用マイクロデバイス	陶 究
14	特願2012-029224	2012/2/14	セシウム吸着材	川本 徹
15	特願2012-029595	2012/2/14	光学素子	井上 貴仁
16	特願2012-031753	2012/2/16	抗酸化能評価用センサー	後藤 正男
17	特願2012-031247	2012/2/16	テラヘルツ波を用いたスクリーニング装置	豊川 弘之
18	特願2012-032722	2012/2/17	無水条件におけるシラノールの製造方法	五十嵐 正安
19	特願2012-032532	2012/2/17	有機薄膜光電変換素子及びこれを用いた有機薄膜太陽電池	河野 隆広
20	特願2012-034435	2012/2/20	ナノ粒子の構造・機能制御法	都 英次郎
21	特願2012-033756	2012/2/20	金属ナノ粒子/ポリイミド複合微粒子及びその製造方法	石坂 孝之
22	特願2012-034692	2012/2/21	スピン電子メモリ及びスピン電子回路	富永 淳二
23	特願2012-039102	2012/2/24	ナノ粒子を利用した遺伝子発現調節法	都 英次郎
24	特願2012-038543	2012/2/24	キャリアプロファイル解析方法、キャリアプロファイル解析装置及び半導体デバイス設計方法	反保 衆志
25	特願2012-040201	2012/2/27	細胞分離用接着基板	中村 史
26	特願2012-040913	2012/2/28	序列化装置、序列化方法及びプログラム	長谷川 良平

2012年 2月分 (31件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
27	特願2012-040964	2012/2/28	イオン液体	松本 一
28	特願2012-041371	2012/2/28	電子デバイスの製造方法及び薄膜トランジスタ	清水 貴思
29	特願2012-041169	2012/2/28	光学測定装置および光学測定方法	多田 哲也
30	特願2012-041314	2012/2/28	シリコン細線光導波路の加工方法	吉田 知也
31	特願2012-043373	2012/2/29	ワーク反転設置機構	小倉 一郎